# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-014912

(43) Date of publication of application: 17.01.1995

(51)Int.CI.

H01L 21/68 B65G 49/07

(21)Application number: 05-177291

(71)Applicant: KOKUSAI ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

24.06.1993

(72)Inventor: IKEDA KAZUTO

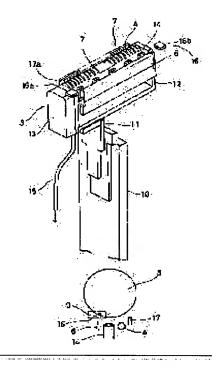
KAIHATSU HIDEKI KANO RIICHI

### (54) ALIGNING DEVICE FOR NOTCH OF WAFER

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To make possible the fitting of a stopper to a notch of a wafer by making a drive roller and the stopper abut on a wafer lower end by providing the drive roller rotatively to a frame which can be lifted and lowered and by providing a plate-like stopper parallel to the drive roller.

CONSTITUTION: When a drive roller 4 and a plate-like stopper 6 are inserted from below a wafer cassette 1, the drive roller 4 and the plate-like stopper 6 abut on a lower part of a wafer 8 and the wafer 8 loaded in a wafer cassette is fitted to a groove 7. The wafer 8 is supported by the stopper 6 and the drive roller 4. When a notch 9 of the wafer 8 is fitted to the plate-like stopper 6, the rotating wafer 8 stops and a notch is registered. After notch alignment, the notch 9 is recognized by a notch recognition sensor 16. Thereby, it is possible to simplify a transfer path in a semiconductor device and to simplify a sequence program.



# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平7-14912

(43)公開日 平成7年(1995)1月17日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/68

M

B65G 49/07

L 9244-3F

庁内整理番号

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-177291

(71)出願人 000001122

国際電気株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)6月24日

東京都中野区東中野三丁目14番20号

(72)発明者 池田 和人

東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電

気株式会社内

(72)発明者 開発 秀樹

東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電

気株式会社内

(72)発明者 狩野 利一

東京都港区虎ノ門二丁目3番13号 国際電

気株式会社内

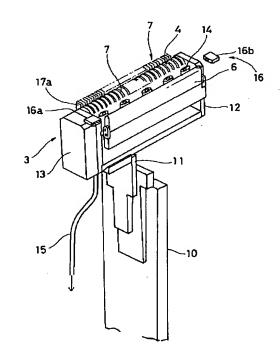
(74)代理人 弁理士 三好 祥二

#### (54) 【発明の名称】 ウェーハノッチ合わせ装置

#### (57)【要約】

【目的】組立て調整の容易なウェーハノッチ合わせ装置 を提供する。

【構成】昇降可能なフレーム12にドライブローラ4を 回転可能に設けると共に、該ドライブローラと平行に板 状のストッパ6を設け、該ドライブローラ、ストッパを ウェーハ下端に当接可能とすると共に、前記ストッパを ウェーハのノッチ9に係合可能とし、ウェーハがドライ ブローラとストッパに乗置した状態でドライブローラを 回転するとウェーハが回転し、ウェーハのノッチがスト ッパに係合してウェーハの回転が停止し、ウェーハのノ ッチ合わせがなされる。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 昇降可能なフレームにドライブローラを 回転可能に設けると共に、該ドライブローラと平行に板 状のストッパを設け、該ドライブローラ、ストッパをウ ェーハ下端に当接可能とすると共に、前記ストッパをウ ェーハのノッチに係合可能としたことを特徴とするウェ ーハノッチ合わせ装置。

【請求項2】 ドライブローラ近傍に局所排気管を設け た請求項1のウェーハノッチ合わせ装置。

【請求項3】 フレーム上昇位置のストッパ先端近傍を 10 通過する光軸を有するノッチ確認センサを具備した請求 項1のウェーハノッチ合わせ装置。

【請求項4】 ウェーハを検出する非接触センサをドラ イブローラと平行に検出するウェーハの数だけ配設して なるウェーハ確認センサを具備した請求項1のウェーハ ノッチ合わせ装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は半導体素子を製造する材 ものである。

[0002]

【従来の技術】半導体製造装置に於いて半導体素子材料 の1つであるシリコンウェーハを処理する場合、膜種に よってはウェーハの結晶方向の向きのバラツキによって 成膜に悪影響を及ぼす場合がある。これを避ける為ウェ ーハにはノッチ、或はオリエンテーションフラットが形 成され、該ノッチ、或はオリエンテーションフラットに よってウェーハの結晶方向、即ちウェーハの姿勢が整え られている。

【0003】ウェーハのノッチによりウェーハの姿勢を 整える従来のウェーハノッチ合わせ装置を図5により説 明する。

【0004】図5に示すウェーハノッチ合わせ装置は、 ウェーハカセットにウェーハが装填された状態で、ウェ ーハのノッチ合わせを行うものである。図6に於いてウ ェーハカセット1とウェーハノッチ合わせ装置2との位 置関係を略述すると、ウェーハカセット1の下方に開口 部があり、該開口部にウェーハノッチ合わせ装置2のノ ッチ合わせ部3を挿入する様になっている。

【0005】ノッチ合わせ部3は昇降可能となってお り、該ノッチ合わせ部3にはドライブローラ4、該ドラ イブローラ4と平行に設けられたガイドローラ5、前記 ドライブローラ4と前記ガイドローラ5との間に設けら れた板状のストッパ6を有している。前記ドライブロー ラ4はウェーハが嵌合する溝7がウェーハのピッチに合 わせて刻設され、側方に設けた回転駆動機構13により 回転される様になっており、又前記板状のストッパ6の 上端はウェーハのノッチに係合する様になっている。

ノッチ合わせについて説明する。

【0007】ウェーハカセット1の下方より前記ノッチ 合わせ部3を挿入すると、前記ドライブローラ4と前記 板状のストッパ6がウェーハ8の下部に当接し、ウェー ハカセットに装填されている各ウェーハ8はそれぞれ前 記溝7に嵌合する。図7で示される様に、ウェーハ8の ノッチ9が前記板状のストッパ6に係合していない時は ウェーハ8は前記ドライブローラ4、板状のストッパ6 に支持され、前記ガイドローラ5からは浮いた状態とな っており、前記ドライブローラ4を回転することで、前 記ウェーハ8が回転される。

【0008】ウェーハ8の回転で前記ノッチ9が前記板 状のストッパ6に係合すると、ウェーハ8の重心位置が 移動し、該ウェーハ8は前記板状のストッパ6と前記ガ イドローラ5に支持され、前記ドライブローラ4からは 浮いた状態となる。この状態でもはやウェーハ8は回転 されることがなく、ウェーハ8は前記板状のストッパ6 によりノッチ合わせがなされ、ノッチ合わせの状態が維 持される。ノッチ合わせの完了していないウェーハ8に 料であるウェーハのウェーハノッチ合わせ装置に関する 20 ついては更に回転が継続してノッチ合わせがなされ、全 てのウェーハ8についてノッチ合わせがなされる。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】上記した従来のウェー ハノッチ合わせ装置では、ウェーハ8が板状のストッパ 6に係合した場合の僅かな重心移動を利用して、多数の ウェーハ8のノッチ合わせを行っており、ドライブロー ラ4、ガイドローラ5、板状のストッパ6の正確な位置 関係を必要とする。この為これらの調整が微妙であり、 多大な時間と労力を要していた。

30 【0010】本発明は斯かる実情に鑑み、組立て調整の 容易なウェーハノッチ合わせ装置を提供しようとするも のである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、昇降可能なフ レームにドライブローラを回転可能に設けると共に、該 ドライブローラと平行に板状のストッパを設け、該ドラ イブローラ、ストッパをウェーハ下端に当接可能とする と共に、前記ストッパをウェーハのノッチに係合可能と したことを特徴とするものである。

40 [0012]

【作用】ウェーハがドライブローラとストッパに乗置し た状態でドライブローラを回転するとウェーハが回転 し、ウェーハのノッチがストッパに係合してウェーハの 回転が停止し、ウェーハのノッチ合わせがなされる。

[0013]

【実施例】以下、図面を参照しつつ本発明の一実施例を 説明する。

【0014】図1中、図5中で示したものと同一のもの には同符号を付してある。

【0006】次に、図7、図8に於いて従来のウェーハ 50 【0015】垂直基板10にスライダ11を垂直方向に

摺動自在に設け、該スライダ11に凹字状の昇降フレー ム12を前記スライダ11に設け、該スライダ11に掛 渡してドライブローラ4を回転自在に設ける。 該ドライ ブローラ4はウェーハ8を回転可能で且金属汚染のない 材質を選定する。又、該ドライブローラ4にはウェーハ のウェーハカセット装填ビッチに等しく溝7を刻設し、 該溝7がウェーハ8の端縁に嵌合可能となっている。前 記昇降フレーム12の側方には回転駆動機構13が設け られ、該回転駆動機構13は前記ドライブローラ4を回 転可能であり、前記スライダ11は図示しない昇降機構 10 で昇降可能である。

【0016】前記ドライブローラ4と対向して板状のス トッパ6を設け、該板状のストッパ6の上端はウェーハ 8のノッチ9に係合可能である。前記ドライブローラ4 と前記ストッパ6との間には所要の間隔で所要数(図で は5本)の局所排気管14を設け、これら局所排気管1 4を排気管15に接続し、該排気管15は図示しない排 気装置に接続する。

【0017】ウェーハカセット1を受載する台(図示せ ず)、又はノッチ合わせ部3にノッチ確認センサ16を 20 設ける。該ノッチ確認センサ16は、投光部16a、受 光部16 bから成る光センサであり、該ノッチ確認セン サ16の光軸はノッチ合わせ時の前記ノッチ確認センサ 16の先端近傍と合致する。

【0018】前記ドライブローラ4の前記局所排気管1 4と反対側にウェーハ確認センサ17を設ける。該ウェ ーハ確認センサ17は前記溝7に嵌合する各ウェーハ8 にそれぞれ対峙させ設けられ、ウェーハ間に挿入可能な 非接触センサ17aの集合である。

【0019】以下、作動を説明する。

【0020】前記スライダ11を上昇させ、ドライブロ ーラ4、板状のストッパ6をウェーハカセット1の下方 より挿入すると、前記ドライブローラ4と前記板状のス トッパ6がウェーハ8の下部に当接し、ウェーハカセッ トに装填されている各ウェーハ8はそれぞれ前記溝7に 嵌合する。図2で示される様に、ウェーハ8は前記板状 のストッパ6とドライブローラ4により支持され、ウェ ーハ8のノッチ9が前記板状のストッパ6に係合してい ない時は前記ドライブローラ4を回転することで、前記 ウェーハ8が回転される。

【0021】ウェーハ8の回転で前記ノッチ9が前記板 状のストッパ6に係合すると、該板状のストッパ6がウ ェーハ8の回転ストッパになり、ウェーハ8の回転が停 止され、ウェーハ8とドライブローラ4とはスリップ状 態となる。他のウェーハ8についても同様にノッチ9が 前記板状のストッパ6に係合する迄回転され且停止す る。而して、全てのウェーハ8についてノッチ合わせが なされる。

【0022】前記局所排気管14は少なくともノッチ合 わせの間吸引排気しており、前記ウェーハ8とドライブ 50 【図7】該従来例の作動説明図である。

ローラ4とのスリップで発生の虞れがあるパーティクル を吸引し、ウェーハ8のパーティクルからの汚染を防止 する。又、前記ウェーハ確認センサ17はノッチ合わせ の間にウェーハ8の有無検出を行い、ウェーハの抜けが ないかを判断する。

【0023】ノッチ合わせ完了後前記スライダ11が降 下すると前記ノッチ確認センサ16によりノッチ9の確 認が行われる。全てのウェーハ8がノッチ合わせされて いると投光部16aからの光が前記受光部16bに受光 され、ノッチ合わせが正常であることが確認され、ウェ ーハ8の1つでもノッチ合わせがされていない場合は前 記投光部16aからの光が遮られることになり、ノッチ 合わせが正常でないと判断される。この場合は更にノッ チ合わせ作業が繰返される。

【0024】上記した様に、本実施例では従来のウェー ハノッチ合わせ装置に対してガイドローラ5を省略した 構造となっており、そのガイドローラ5が設けられてい た空間に前記ウェーハ確認センサ17を設け、空間の有 効利用を図っている。更に、ウェーハ8の有無検出がノ ッチ合わせ作業と平行して行われるので無駄がなく能率 的である。従来、ウェーハ有無検出の為、別途ウェーハ 確認センサを具備するウェーハ有無検出ステーションを 設け、各ウェーハカセットの搬送途中に前記ウェーハ有 無検出ステーションを経由することでウェーハの有無を 検出している。従って、本実施例では半導体製造装置の 簡素化と共に半導体製造装置に於ける搬送経路の簡素 化、シーケンスプログラムの簡素化が図れている。

【0025】更に、前記ノッチ確認センサ16によるノ ッチ合わせの確認が行えるので、ノッチ合わせ作業の信 30 頼性が向上する。

【0026】尚、上記実施例では局所排気管14を設 け、ドライブローラ4周囲を積極的に吸引したが、エア を含むクリーンガスが流通する雰囲気に設ける場合は、 局所排気管14は省略することも可能である。

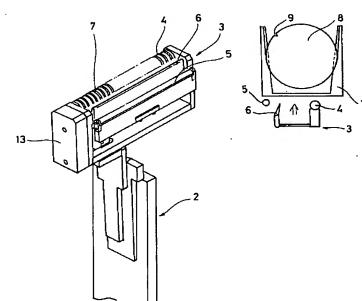
#### [0027]

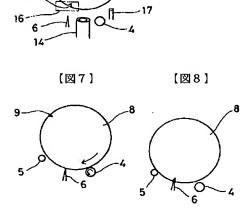
【発明の効果】以上述べた如く本発明によれば、部品点 数が減少し、微妙な位置合わせ作業が不要となるので、 組立て調整が著しく簡単になり、又ウェーハ確認センサ が取付け可能であり、該ウェーハ確認センサを取付けた 40 場合は半導体製造装置の簡素化と共に半導体製造装置に 於ける搬送経路の簡素化、シーケンスプログラムの簡素 化が図れる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施例を示す斜視図である。
- 【図2】該実施例の作動説明図である。
- 【図3】該実施例の作動説明図である。
- 【図4】該実施例の作動説明図である。
- 【図5】従来例を示す斜視図である。
- 【図6】該従来例の作動説明図である。

(4) 【図8】該従来例の作動説明図である。 \* 8 ウェーハ 【符号の説明】 ノッチ ウェーハカセット 14 局所排気管 ı ドライブローラ 16 ノッチ確認センサ 6 ストッパ 17 ウェーハ確認センサ 7 溝 【図1】 【図2】 【図3】 【図5】 【図6】





【図4】